

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	技術代行カテゴリ	備考(注1)	利用報告書提出 データ提供あり			利用報告書提出 データ提供なし			利用報告書非提出(注7) データ提供あり			利用報告書非提出(注7) データ提供なし		
						機器利用	技術補助(注3)	技術代行(注4,5,6)	機器利用	技術補助(注3)	技術代行(注4,5,6)	機器利用	技術補助(注3)	技術代行(注4,5,6)	機器利用	技術補助(注3)	技術代行(注4,5,6)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800 FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8000	16500	20000	11200	23100	28000	16000	33500	40000	22400	46900	56000
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	14500	26400	29900	29000	46500	50500	40600	65100	70700
NPF008	スピノーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF009	コンタクトマスクライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	6400	23900	27900	8900	33400	39000
NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF011	線露光装置(注8)	CR3 イエロールーム	リソグラフィ	3	技術代行・補助専用	19500	28000	31500	27300	39200	44100	52000	69500	76000	72800	97300	106400
NPF012	有機ドラフトチャンバー 右(フォト)(注9)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF013	有機ドラフトチャンバー 左(フォト)(注9)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF014	有機ドラフトチャンバー 右(EB)(注10)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 右	CR1 クリーンルーム	表面処理	3		500	9000	12500	500	9000	12500	6200	23700	30200	7700	23700	30200
NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	27900	31900	14500	39000	44600	
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	14500	26400	29900	29000	46500	50500	40600	65100	70700
NPF021	プラズママッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	8000	16500	19000	11200	23100	26600	17600	35100	39100	24600	49100	54700
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	8800	26300	30300	12300	36800	42400
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	9600	27100	31100	13400	37900	43500
NPF029	ツッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2600	11100	14600	3600	15500	20400	8000	25500	32000	11200	35700	44800
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4600	13100	15600	6400	18300	21800	16000	33500	37500	22400	46900	52500
NPF031	原子層堆積装置[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8000	16500	19000	11200	23100	26600	19200	36700	40700	26800	51300	56900
NPF032	クロスセクションポリリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	9600	27100	31100	13400	37900	43500
NPF033	アルゴリズムリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	9600	27100	31100	13400	37900	43500
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13000	21500	25000	18200	30100	35000	29000	46500	53000	40600	65100	74200
NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9100	17800	20100	12700	24600	28100	25000	42500	46500	35000	59500	65100
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2000	10500	11700	2800	14700	16300	6400	23900	25100	8900	33400	35100
NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	700	12600	14200	4000	21500	22700	5600	30100	31700
NPF044	マップ炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV/Dimension3100](注12)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5600	17500	22400	10400	27900	34400	14500	39000	48100
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700](注12)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5600	17500	22400	10400	27900	34400	14500	39000	48100
NPF048	ナノスケール顕微鏡SPM_3[SFT-3500](注12)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	13700	17200	7200	19100	24000	13000	30500	37000	18200	42700	51800
NPF049	ナノプローブ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10400	18900	22400	14500	26400	31300	22400	39900	46400	31300	55800	64900
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	700	12600	14200	4000	21500	22700	5600	30100	31700
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	6400	23900	27900	8900	33400	39000
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	5600	23100	27100	7800	32300	37900
NPF053	ワイヤボンダー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	6400	23900	27900	8900	33400	39000
NPF054	ダインゲソウ	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4600	13100	16600	6400	18300	23200	13000	30500	37000	18200	42700	51800
NPF055	スクライパー	CR4 クリーンルーム	その他	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	1300	9800	12300	1800	13700	17200	4000	21500	25500	5600	30100	35700
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	15500	17200	7200	24700	25900	10000	34500	36200
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	15500	17200	9000	26500	27700	12600	37100	38700
NPF063	分光エリプソメータ(注11)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	12300	3600	15500	17200	8000	25500	26700	11200	35700	37300
NPF064	解析用PC(分光エリプソメータ用)(注11)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	21500	28000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)(注12)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	9600	27100	31100	13400	37900	43500
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)(注12)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	6400	23900	27900	8900	33400	39000
NPF067	解析用PC(SPM, FT-IR, Raman用)(注12)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	700	12600	17500	4000	21500	28000	5000	30100	39200
NPF068	磁性特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	3300	11800	14300	4600	16500	20000	7200	24700	28700	10000	34500	40100
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5600	17500	21000	10400	27900	31900	14500	39000	44600
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3600	15500	19000	6400	23900	27900	8900	33400	39000
NPF073	解析用PC(X線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	21500	28000
NPF074	X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	7200	19100	22600	9600	27100	31100	13400	37900	43500
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	21500	28000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SIN)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	7200	19100	22600	16000	33500	37500	22400	46900	52500
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	技術代行専用	11700	20200	22700	16300	28200	31700	29000	46500	50500	40600	65100	70700
NPF084	デジタルマイクロスコブ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	21500	22700
NPF085	物理特性測定装置(CPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング												

(注8)NPF011 i線露光装置は、技術補助又は技術代行でご利用いただけます。ご利用方法については、装置担当者と事前に打ち合わせを行って下さい。

(注9)NPF012及びNPF013ドラフトチャンバはCR2内露光装置(NPF006、110、119、120)の塗布・現像場所も兼ねております。両装置のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF012を申請してください。

(注10)NPF014、NPF015、NPF111、NPF112のドラフトチャンバー4台のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF014を申請してください。

(注11)NPF064はNPF063のデータ解析用PCです。NPF063と同時にトレーニングします。

(注12)NPF067は、NPF046、047、048、065、066の共用のデータ解析用PCです。NPF046、047、048、065、066のいずれかをトレーニングを申請されると、同時にトレーニングします。

(注13)NPF094のCADツールは、L-Editとなります。

(注14)NPF115、NPF116、NPF121 は、2025年4月以降公開予定です。利用可能になりましたら、お知らせいたします。

(注15)NPF117、NPF118、NPF119は、現在準備中です。利用可能になりましたら、お知らせいたします。